

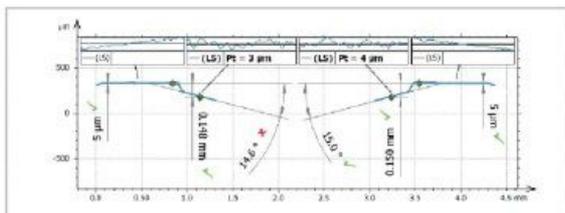
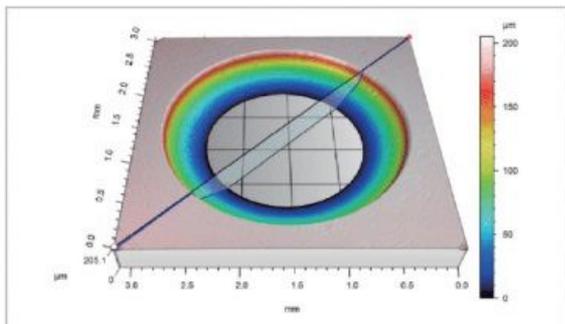
3D Оптический профилометр

Модельная серия OPL-2000



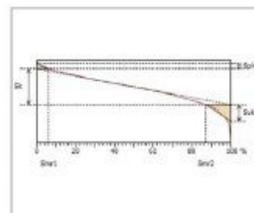
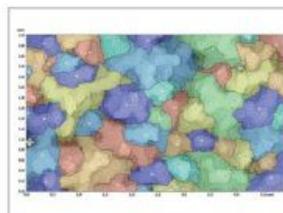
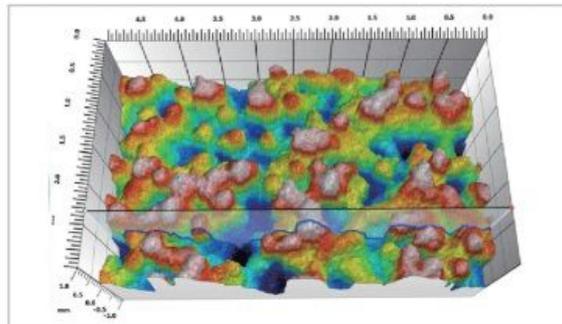
Измерение поперечного сечения

Получение геометрических данных в любых поперечных плоскостях. Высота профиля, плоскостность, ширина, угол, радиус и др.



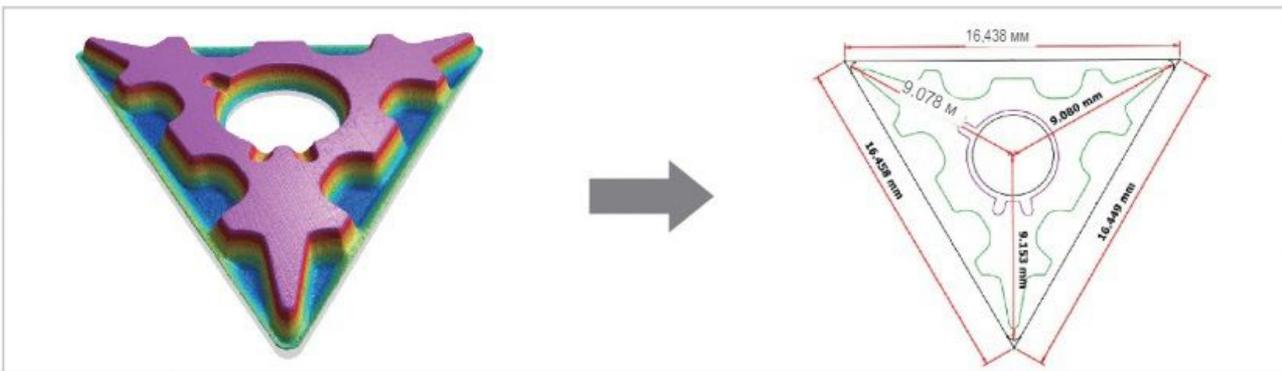
Измерение объемных данных

Получение объемных данных в любых плоскостях. Объемы, площади поверхностей, сечения, вогнутых и выпуклых частей, замер средних величин, максимумов и др.



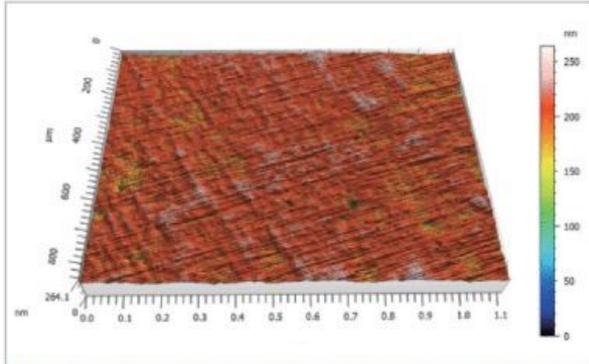
Перевод кривых

Полученные данные можно перевести в кривые в автоматическом режиме и использовать полученные данные с целью последующего создания чертежей, используя вспомогательные линии, пересечения кривых и др.

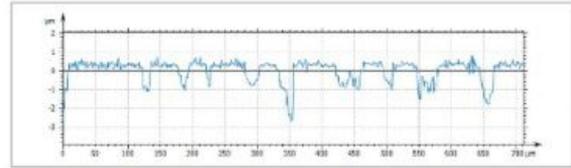


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Определение шероховатости и плоскостности неполированной металлической пластины



Использование 10-кратного интерференционного объектива Mileg и Метода вертикальной сканирующей интерферометрии (VSI)

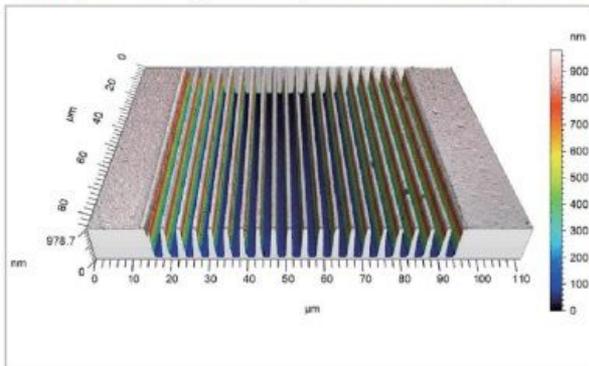


ISO 12781

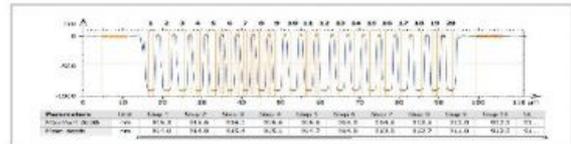
Параметры плоскостности

FLTt	16.90	nm
FLTp	7.700	nm
FLTv	9.200	nm
FLTq	4.050	nm

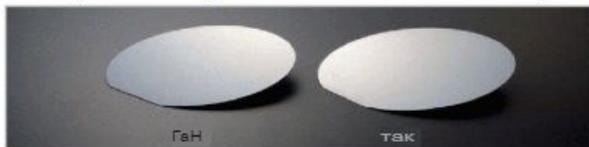
Измерение глубины травления поверхности пластины



С помощью 100-кратного интерференционного объектива и Метода вертикальной сканирующей интерферометрии (VSI)



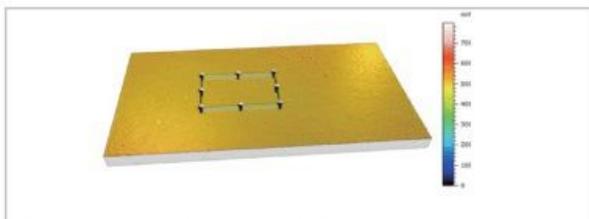
Измерение шероховатости по шкале Брика на поверхности пластины



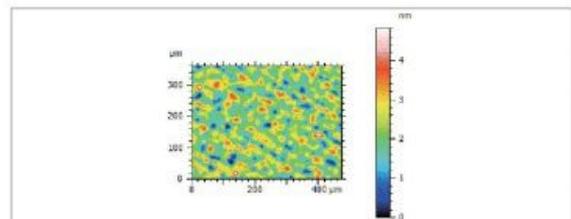
ISO 25178

Параметр высоты

Sa	0.527	µm
----	-------	----



Используется 10-кратный миллиметровый объектив и Метод вертикальной сканирующей интерферометрии (VSI).



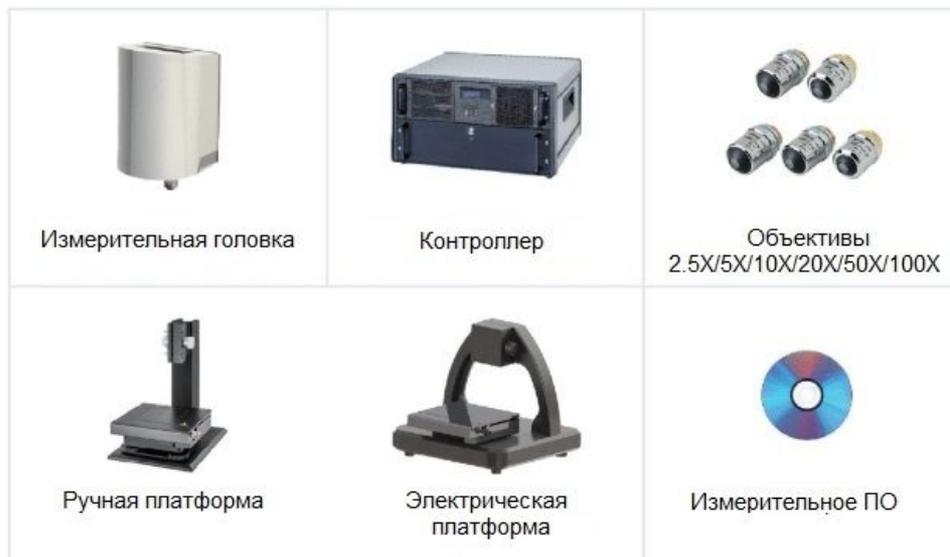
СОСТАВ СИСТЕМЫ

РАЗМЕР ПЛАСТИН

По запросу клиента, платформа конфигурируется под нужный размер пластин (стандартно 100 мм, доступно также 200 мм и 300 мм)

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Прибор дополнительно комплектуется системами активной или пассивной виброизоляции при необходимости



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	OPL-2500	OPL-2600	OPL-2700
Диап. сканирования по z	5000 μm	400 μm	100 μm
Макс. скорость сканиров.	400 $\mu\text{m/s}$	400 $\mu\text{m/s}$	200 $\mu\text{m/s}$
Разрешение	0.1 nm	0.01 μm	0.01 μm
Воспроизводимость измер.	< 5 nm	< 0.15 nm	< 0.03 nm
1 σ воспроизвод. 0.4 мкм	< 10 nm	< 1 nm	< 1 nm
1 σ воспроизвод. 12 мкм	< 20 nm	< 3 nm	< 3 nm
1 σ воспроизвод. 100 мкм	< 30 nm	< 20 nm	-
Разрешение съемки	1920 x 1200		2456 x 2054
Принцип измерения	интерференция белого света		
Система позиционирования	пьезоэлектрическая подвижка		
Вес датчика	2 кг		
Допустимая влажность	0–80%		
Допустимая температура	10 °C–35 °C		
Питание	100–240 VAC, 50/60 Hz		

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТИВА

	OPL-2700						
Объектив/увеличение	2.5x	5x	10x	20x	50x	100x	115x*
Рабочее расстояние мм	10.3	9.3	7.4	4.7	3.4	2	0.7
Диапазон измерения мм ²	3.4 x 2.8	1.7 x 1.4	0.85 x 0.71	0.43 x 0.36	0.17 x 0.14	0.09 x 0.07	0.075 x 0.06
Расст. между точками мм	1.4	0.7	0.35	0.175	0.07	0.035	0.03
Кол-во точек сканирования	2456 x 2054						
Скорость сканирования	77 - 2000 Hz						
	OPL-2500/OPL-2600						
Рабочее расстояние мм	10.3	9.3	7.4	4.7	3.4	2	0.7
Диапазон измерения мм ²	7.3 x 4.6	3.7 x 2.3	1.8 x 1.2	0.91 x 0.58	0.37 x 0.23	0.18 x 0.12	0.16 x 0.1
Расст. между точками мм	3.8	1.9	0.96	0.48	0.19	0.1	0.08
Кол-во точек сканирования	1920 x 1200						
Скорость сканирования	169 -3200 Hz						

ПАРАМЕТРЫ ПЛАТФОРМЫ

Рабочее расстояние мм	73 x 55	75 x 50	100 x 100	150 x 150	200 x 200	300 x 300
Диапазон измерения мм ²	ручной	электр.	электр.	электр.	электр.	электр.
Расст. между точками мм	1	1	2	3	3	5
Кол-во точек сканирования		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Скорость сканирования	70 (регулируется по высоте)					
	± 3°					